

WAFER CHUCK CON SISTEMA A VUOTO E CONTROLLO DI TEMPERATURA **EFESTO**

Efesto è il disco studiato per fornire l'adeguato alloggiamento per il test dei wafer circolari di semiconduttori (silicio, germanio, ecc.)

Munito di fori di aspirazione per il collegamento a pompa da vuoto, in modo da mantenere i *wafer* in posizione, **Efesto** è inoltre equipaggiato con un sistema di termostatazione e garantisce precisione, affidabilità e flessibilità per i test e la caratterizzazione dei wafer.

Efesto rappresenta la soluzione ideale per essere utilizzato in sinergia con i supporti per aghi **Precision Probe** di IPSES, ma può essere integrato anche in sistemi di terze parti.



IL DISCO DI CONTATTAZIONE

Il disco di **Efesto** su cui vengono posti i *wafer* da testare è costruito in rame.

Per aumentarne la conducibilità elettrica il disco è completamente rivestito in oro, con uno spessore medio di 0,15 μ m.

Alto 20 mm e con un diametro di 150mm, **Efesto** permette di testare *wafer* che possono giungere al diametro di 80mm (4 pollici).

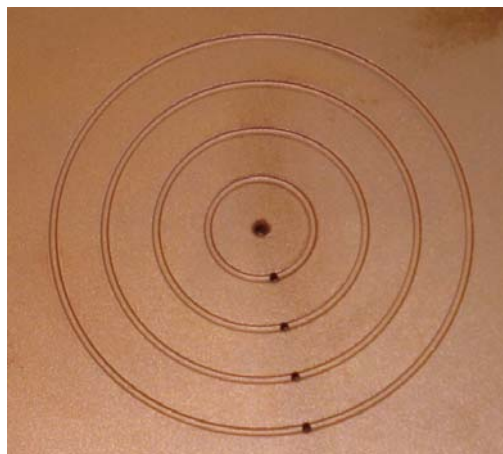
L'ASPIRAZIONE

Due differenti canali di aspirazione garantiscono il mantenimento in posizione sia dei *wafer*, sia di elementi singoli.

Quattro solchi concentrici, distanziati tra loro di 10mm, al cui interno sono predisposti 4 fori, permettono di mantenere solidali i *wafer* al disco.

Un quinto foro centrale, indipendente dagli altri 4, consente la sola aspirazione centrale, per garantirne l'utilizzo con celle singole.

Due differenti valvole regolano l'aspirazione indipendente dai fori esterni e da quello centrale.



IL CONTROLLO DELLA TEMPERATURA

Un secondo disco in nylon, anch'esso dello spessore di 20 mm, solidale a quello di contattazione, permette il raffreddamento di **Efesto**.

Due valvole connesse ad un *chiller* (opzionale) tramite tubi permettono il ricircolo dell'acqua all'interno del sistema, in modo da mantenere costante la temperatura ed evitare il surriscaldamento del sistema.

Un foro, posto sul lato del disco di contattazione permette di monitorare costantemente la temperatura del dispositivo in misura attraverso un sensore di temperatura (opzionale).

Il *wafer chunk Efesto* misura 150 mm di diametro e 40 mm di altezza. Il suo ancoraggio al sistema è garantito da quattro fori posti sotto al basamento del disco. Può essere acquistato, separatamente, un reggi-disco con perno centrale.

Su richiesta è possibile avere *wafer chunk* di forme e dimensioni diverse.

CONTATTI

Sede operativa e centro di sviluppo:

via Lazzarotto, 10
20020 Cesate (MI)

tel. +39 02 39449519
fax +39 02 700403170
e-mail: info@ipses.com
<http://www.ipses.com>

